

超高压電子顕微鏡センター 基盤技術研究分野

(大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 協力講座)

当研究室では、超高压電子顕微鏡を中心として、電子光学・装置開発・新しい観測法の研究を行っています。

< 研究テーマ >

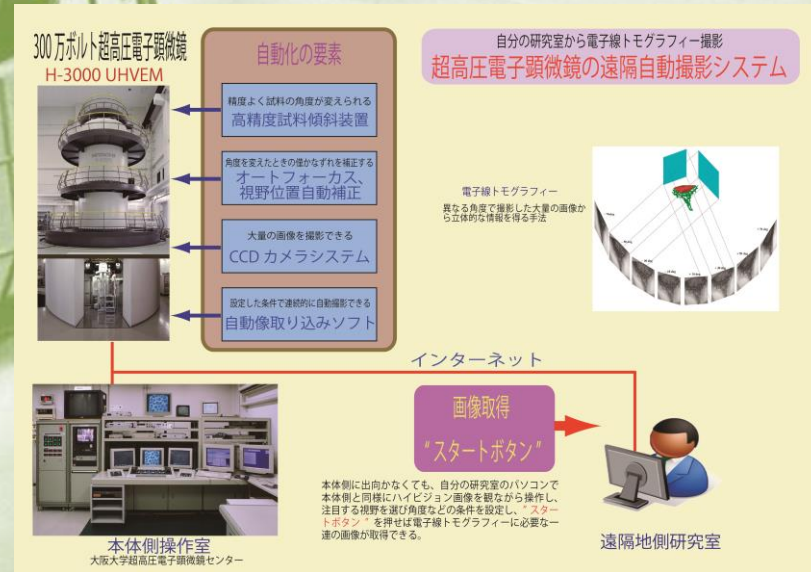
- ・電子線トモグラフィーの自動化システム開発
- ・超高压電子顕微鏡における電子線透過能の解析とミクロンサイズ材料のトモグラフィー観察
- ・収差補正電子光学系の理論研究
- ・収差補正電子顕微鏡によるデバイス材料の原子レベル構造解析
- ・電子回折顕微法の開発

< スタッフ >

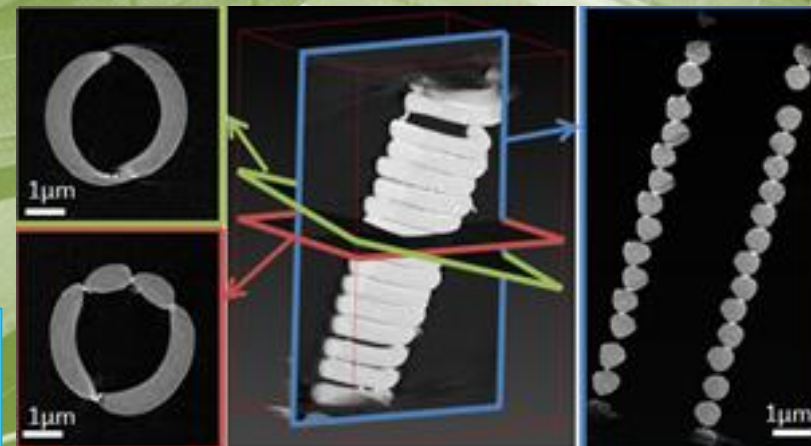
西 竜治 准教授 rnishi@uhvem.osaka-u.ac.jp

山崎 順 准教授 yamasaki@uhvem.osaka-u.ac.jp

TEL: 06-6879-7941 URL: <http://www.uhvem.osaka-u.ac.jp/>



トモグラフィー自動撮影支援機能を付加した超高压電子顕微鏡



直径 $3.7\mu\text{m}$ のカーボンマイクロコイルの高精度三次元再構成